酸化錫担持ナノグラフェンの液中プラズマ生成

In-liquid plasma formation at low temperature for *in-situ* binding of SnO₂/Graphene 名大エ ⁰(D) ボルーデ ランジット, 杉浦 啓嗣, 石川 健治, 堤 隆嘉, 近藤 博基, 五十嵐 信行, 堀 勝 Nagoya Univ. ^oRanjit R. Borude, Hirotsugu Sugiura, Kenji Ishikawa, Takayoshi Tsutsumi, Hiroki

Kondo, Nobuyuki Ikarashi, and Masaru Hori

E-mail: borude.ranjit.rohidas@d.mbox.nagoya-u.ac.jp

<u>はじめに</u> グラフェン電池やリチウム電池の アノード電極には酸化錫微粒子担持グラフェ ンの高速かつ低コスト合成が求められている. これまでに,エタノールの液中プラズマによる 高い結晶性を有するナノグラフェンの合成を 報告してきた [1]. 今回,酸化錫微粒子の担持 ナノグラフェンの作成に成功した.

<u>実験方法</u> エタノールに液中プラズマを発生 させてナノグラフェンの合成する際,(1)先に ゾルゲル作成した酸化錫微粒子を分散,または (2)塩化錫を溶解させておいて,酸化錫の微粒 子担持ナノグラフェンの作成した.合成物を濾 過捕集して乾燥した後,電子顕微鏡観察や X 線回折法,ラマン散乱分光法,赤外分光法,透 過率測定,導電性評価を実施した.

<u>結果と考察</u> Fig. 1 は合成したナノグラフェン の透過電子顕微鏡 (TEM) 観察結果を示す. 酸化錫の微粒子が直径 2.6~3.0nm の大きさで 高密度に合成された.高分解能 TEM より格子 間隔 3.53Åの SnO₂(110)面と, 3.33Åの C(002) 面が見てとれる.酸化錫の微粒子担持ナノグラ フェンは X 線回折やラマン散乱,赤外分光の 結果からも支持される.液中プラズマは水素原 子と水酸基の生成を伴うため,塩化錫を還元し, SnCl₂ + H₂ \rightarrow Sn²⁺ + HClの錫イオンが水酸基で 酸化され SnO₂を生成する反応,エタノールの 脱水素化反応から共役ジエンの生成を経て,環 化反応によるグラフェンの合成反応が示唆さ れる.高温プロセスではなく,溶液原料から開始した液中プラズマによる低温合成によって,酸化錫微粒子の同時合成も可能とし,スケーラブルで簡便な合成方法が実現された.



Fig. 1 Surface morphology and elemental analysis of SNp/GNs composite. (upper) Transmission electron microscopy (TEM) image and (inset) energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) analysis (lower) High resolution TEM image.

<u>参考文献</u> [1] T. Hagino Appl. Phys. Express 5, 035101 (2012). [2] R. Borude et al. J. Phys. D: Appl. Phys. (2019) in review; ACS Appl. Nano. Mater. (2019) in review.